

Niskociśnieniowy system plazmowy V6-G

Wydajna jednostka stołowa



Łatwa obsługa dzięki przyjaznemu dla użytkownika panelowi dotykowemu z przejrzystym menu.

Standardowa jednostka V6-G została zaprojektowana jako urządzenie stołowe do przemysłowej produkcji małoseryjnej, a także do niskociśnieniowej obróbki plazmowej w laboratoriach badawczo-rozwojowych.

Może być używane do procesów obróbki powierzchni, czyszczenia i aktywacji.

Zintegrowany profesjonalny sterownik PLC służy do przechowywania definiowalnych procesów i parametrów.

Opcje

- Pompa próżniowa
- Pułapka ozonowa
- Do dwóch dodatkowych wlotów gazu
- Bęben obrotowy do obróbki materiałów sypkich
- Stojak z półkami
- Boczne sprzęgło mikrofalowe
- Miękki start i powolne odpowietrzanie
- Zdalna konserwacja (VPN) / Interfejs USB / Ethernet i kontroler o rozszerzonej funkcjonalności

Cechy systemu

- Sprzężenie mikrofalowe od góry
- Drzwiczki uchylne
- Automatyczne odpowietrzanie linii pompy po wyłączeniu systemu

Dane techniczne

Wymiary systemu (szer. x gł. x wys.): 640 x 710 x 710 mm

Wymiary komory (szer. x gł. x wys.): 170 x 200 x 170 mm

Częstotliwość wzbudzenia plazmy: Mikrofałe (2.45 GHz)

Moc mikrofal: 50-300 W

Wloty gazu z regulatorem masowego przepływu: 1 kanał

Zasilanie: 230 V, 50 / 60 Hz

Pobór mocy (bez pompy próżniowej): 0,5 kVA

Wakuometr: Pirani

Waga: 100 kg

